

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Квантовые вычисления на квантовых точках в полупроводниковых микрорезонаторах. Часть II

А. В. Цуканов, И. Ю. Катеев

403

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Исследование селективности травления различных материалов пучками быстрых нейтральных частиц

Ю. П. Маишев, С. Л. Шевчук, В. П. Кудря

415

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Влияние полимерной матрицы и фотогенератора кислоты на литографические свойства химически усиленного фоторезиста

С. А. Булгакова, Д. А. Гурова, С. Д. Зайцев, Е. Е. Куликов, Е. В. Скороходов, М. Н. Торопов, А. Е. Пестов, Н. И. Чхало, Н. Н. Салащенко

419

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Кинетика и режимы плазмохимического травления GaAs в условиях индукционного ВЧ разряда в CF_2Cl_2

А. М. Ефремов, Д. Б. Мурин, А. Е. Левенцов

429

Исследование латерального распределения частиц BF_3 плазмы с помощью двухракурсной эмиссионной томографии

А. В. Фадеев, К. В. Руденко

435

Процессы самоорганизации при электролитическом формировании наноструктур в полупроводниковых системах на основе кремния

Н. А. Аржанова, М. А. Проказников, А. В. Проказников

441

МЕТРОЛОГИЯ

Виртуальный растровый электронный микроскоп.

4. Реализация на основе симулятора

Ю. А. Новиков

456

Электрофизические свойства пленок ЦТС, легированных лантаном

Ю. В. Подгорный, А. С. Вишневский, К. А. Вортилов, П. П. Лавров, А. Н. Ланцев

468

СХЕМОТЕХНИКА

К модели кольцевого генератора на КМДП инверторах

В. А. Лементуев

475

Вниманию авторов

479